

Prof. Dr. rer. nat. habil. Rosemarie Hild

Tagungsbände/Poster/Vorträge seit 1985

- G. Nitzsche, R. Hild, S. Kessler
Der Einfluß partiell kohärenter Übertragungsverhältnisse auf die defokussierte Abbildung spezieller Objekte
Tag.-Ber., Akad. Landwirtsch.-Wiss. DDR, Berlin 234 (1985), 71-83
- R. Hild, G. Nitzsche, L. Leine, S. Kessler
Defokussierte Abbildung und partielle Kohärenz
Tag.-Ber., Akad. Landwirtsch.-Wiss. DDR, Berlin 234 (1985), 85-91
- G. Nitzsche, R. Hild, L. Leine
Theoretische Untersuchungen zur defokussierten Abbildung von Zellstrukturen
CAIP '85 Berlin, Abstracts, Poster
- S. Kessler, R. Hild, G. Nitzsche
Vergleich von Auflicht- und Durchlichtverfahren in der Mikroskopie unter dem Gesichtspunkt der Kohärenztheorie
CAIP '85 Berlin, Abstracts, Poster
- R. Hild, G. Nitzsche
Einfluß von partiell-kohärenter Beleuchtung und Defokussierung von Auflichtkanten
FSO Dresden 1986, Poster
- R. Hild, G. Nitzsche, J. Hebenstreit
Partiell-kohärente optische Filterung für ein optisches System mit Abbildungsfehlern
Beiträge Optik und Quantenelektronik 11 (1986), 160
- J. Hebenstreit, R. Hild, G. Nitzsche
Partiell-kohärente Filterverfahren mit strukturierter Lichtquelle
Beiträge Optik und Quantenelektronik 12 (1987), 107
FSO Erfurt 1987, Poster
- R. Hild, G. Nitzsche
Eigenschaften der Bildentropie bei mikroskopischer defokussierter Abbildung
Beiträge Optik und Quantenelektronik 12 (1987), 109
- G. Nitzsche, R. Hild
Mikroskopische defokussierte Abbildung von Höhenprofilen
Beiträge Optik und Quantenelektronik 12 (1987), 59, FSO Erfurt 1987, Vortrag
- G. Nitzsche, R. Hild
Fokus Kriterien auf der Basis von Struktureigenschaften im Bild
CAIP '87 Wismar, Abstracts, 182; Poster
- G. Nitzsche, R. Hild
Kontrastfunktionen als Fokus Kriterien
CAIP '87 Wismar, Abstracts, 184; Poster
- R. Hild, G. Nitzsche, S. Kessler
Theoretische Untersuchungen zum Nachweis von Schlieren mittels Interferometrie
Beiträge Optik und Quantenelektronik 14 (1989), 100-102

R. Hild, S. Kessler, J. Hebenstreit, L. Leine
Influence of schlieren with various structure on PSF and MTF
EAC Jena 1989, Abstracts, 40; Poster

R. Hild, G. Nitzsche
Influence of schlieren on PSF
EAC Jena 1989, Poster

R. Hild, G. Nitzsche
Influence of schlieren on MFT
EAC Jena 1989, Poster

G. Nitzsche, R. Hild
Focus criterions on the base of Fourier-transformed images and of correlation
CAIP '89 Leipzig, Proceedings, 74-75; Poster

S. Kessler, R. Hild, G. Nitzsche, J. Hebenstreit
Three-Dimensional Microscopic Imaging
ICO-Conference, Garmisch-Part. 1990; Poster

R. Hild, G. Nitzsche
Einfluß von Schlieren auf die Punktbildfunktion bzw. die
Modulationsübertragungsfunktion eines Abbildungssystems
Beitr. Optik und Quantenelektronik 15 (1990), 130; Poster

R. Hild, G. Nitzsche
Einfluß von Schlieren auf die kohärent optische Abbildung
Beitr. Optik und Quantenelektronik 15 (1990), 130; Poster

G. Nitzsche, R. Hild, S. Kessler
Imaging of 3-D Bar and Groove Objects
Aplikovaná Optika 91 I, 120; Vortrag

R. Hild, G. Nitzsche, S. Kessler
Partially coherent imaging of alignment marks
Aplikovaná Optika 91, I, 124; Vortrag

R. Hild, G. Nitzsche, S. Kessler
Partiell kohärente Abbildung von Überdeckungsmarken
DGAO Tagung 1991 Oldenburg; Poster

R. Hild, G. Nitzsche
Partially coherent imaging of alignment marks in photolithography
ME'91 Rom
Microcircuit Engineering 91, Elsevier, Amsterdam, London, New York, Tokyo, 291-294

G. Stamm, U. Selbmann, R. Hild, G. Nitzsche
Theoretical and experimental investigations with regard to the alignment system of wafer-
stepper from Jenoptik Jena GmbH
ME '91 Rom
Microcircuit Engineering 91, Elsevier, Amsterdam, London, New York, Tokyo

R. Hild, G. Nitzsche
Optical Filtering as an Alternative Method to Phase Shifting

ME'92 Erlangen

Microelectronic Engineering 21. (1993), 57-60

R. Hild, G. Nitzsche

Is it possible to replace phase shifting by optical filtering?

International Conference, Padova 1992

Abstract Booklet, B11

R. Hild, G. Nitzsche

Möglichkeiten der Bildverarbeitung zur Verbesserung der Auflösung in der
Photolithography

DGaO-Tagung, Wetzlar 1993

G. Nitzsche, R. Hild, U. Altenburger

Optische Probleme der Waferinspektion

DGaO-Tagung, Wetzlar 1993

R. Hild, G. Nitzsche

Superresolutionlithography from Viewpoint of Partially Coherent Imaging Theory

16. ICO Conference Budapest 1993

R. Hild, G. Nitzsche

Physical limits of superresolution lithography

ME'93 Maastricht

Microelectronic Engineering 23 (1994), 179-182

R. Hild, G. Nitzsche, U. Altenburger

Optical image processing-a useful tool in wafer inspection

ME '93 Maastricht

Microelectronic Engineering 23 (1994), 391-394

R. Hild, J. Wienecke, G. Nitzsche, U. Altenburger

Colour image processing-a new inspection tool

MNE' 94 Davos

R. Hild

The physical limits of superresolution lithography

Autonome Universität Barcelona, Nov. 1994

R. Hild

Optical problems of wafer inspection

Autonome Universität Barcelona, Nov. 1994 und

Universitat Politecnica Catalunya Terrassa (Barcelona), Dez. 1994

R. Hild

About the possibilities for optical preprocessing for wafer inspection

Autonome Universität Barcelona, Nov. 1994

R. Hild, L. Leine, R. Muschall

Diskussion des spektralen Verhaltens von Wafern
DGaO Jahrestagung Binz 1995

R. Hild, M. J. Yzuel, J. Campos, J. C. Escalera

Verbesserung der Auflösung photolithographischer Systeme durch optische Filterung
DGaO Jahrestagung Binz 1995

M. J. Yzuel, J. Campos, J. C. Escalera, R. Hild,

Improvement of the response of a photolithographic system using nonuniform pupils
OSA Meeting USA 1995

R. Hild, M. J. Yzuel, J. Campos, J. C. Escalera

About the possibilities of nonuniform pupils in photolithography
EOS-Annual Meetings Digest Series vol 2A, 348-350, Prag 1995

J. Campos, J. C. Escalera, R.Hild, R. Muschall, G. Nitzsche, M. J. Yzuel

Assesment of nonuniform pupils in photolithography

MNE'95 Aix

Microelectronic Engineering 30 (1996), 103-106

R. Hild, R. Muschall, G.Nitzsche, A. Wienecke

Investigations into the spectral behaviour of wafers and CD-measurement

MNE'95 Aix

Microelectronic Engineering 30 (1996), 583-585

R. Hild, J.C. Escalera, M.J. Yzuel, G. Nitzsche

High focal depth imaging by beam shaping optical elements ?

MNE'96 Glasgow; Microelectronic Engineering 35 (1997), 205-208

R. Hild, J.C. Escalera, M.J. Yzuel

Abbildungen hoher Fokustiefe durch strahlformende optische Elemente ?

DGaO Jahrestagung Banz 1997

R.Hild

Mikromechanische Drucksensoren mit optischer Detektion in Flüssigkeiten

DGaO Jahrestagung Bad Nenndorf 1998

R. Hild, J.Jahns

Simulation of Fresnel diffraction for simple objects and various angles of incidence

eingereicht zur Tagung „Diffractive Optics“ August 1999

R. Hild

Optische Probleme bei Inspektion und Metrologie für Stukturbreiten um 0,1 μm im DUV

DGaO Jahrestagung Göttingen 2001

R. Hild,

Optical problems of wafer inspection with DUV microscopy for structures of about 0.1 μm

MNE'01 Grenoble; Microelectronic Engineering 61-62 (2002), 1093-1100

Vortrag FRT-Erlangen 16.06.04

Einfluss von Parametern des optischen Systems auf die Abbildung von Strukturen nahe der Auflösungsgrenze

Vortrag NanoWorldServices GmbH 17.11.04

Diskussion des Abbildungsverhaltens metallischer Strukturen nahe der Auflösungsgrenze

Poster DGaO Jahrestagung 2004, Bad Kreuznach

R. Hild, Spektralradiometrische Messungen an Medienfassaden

Poster Photonics Europe, Strasbourg

R. Hild,

Angular spectrum description of light propagation in planar diffractive optical elements
Proc. SPIE vol. 5456, 364-373

U. Huebner, W. Morgenroth, R. Boucher, H.G. Meyer, Th. Sulzbach, B. Brendel, W. Mirandé, E. Buhr, G. Ehret, Th. Fries, G. Kunath-Fandrei and R. Hild, "Prototypes of new nanoscale CD-standards for high resolution optical microscopy and AFM" in Proceedings of the 5th international euspen conference, Montpellier, 185-188, 2005

Uwe Huebner, W. Morgenroth, R. Boucher, W. Mirandé, E. Buhr, Th. Fries, Nadine Schwarz, G. Kunath-Fandrei and R. Hild, "Development of a nanoscale linewidth-standard for high-resolution optical microscopy" in Optical Fabrication, Testing, and Metrology II,
SPIE – Conference Jena 2005

R. Hild, Diskussion des Abbildungsverhaltens metallischer Strukturen nahe der Auflösungsgrenze, Vortrag Jena Juni 05

R.Hild, Bewertung der optischen Abbildung der Kalibriernormale
Vortrag Braunschweig, 1.12.06